



大型サンプルの全面コーティングに最適  
Ideal for full-surface coating of large samples

**4 to 8-inch type ION SPUTTER**

<Features>

- 4、5、6、7、8、と1インチ単位で選択可能  
Available for coating samples of 4,5,6,7 and 8 inches respectively
- 膜ムラの少ないコーティングが可能  
Irregularities in the coated film are minimal.
- ベルジャーを持ち上げる必要のない全面ドア式  
Front door type sputter eliminates the need for raising the bell jar.
- 電極膜・反射膜コーティングにも使用可能  
Able to use for both electrode film and reflection film coating

DESK TOP QUICK COATER

**SC-708**

## SC-708 仕様 (SPECIFICATIONS)

ターゲットサイズ	4~8インチ dia.
試料サイズ	4~8インチ dia.
排気操作	自動式
スパッタ方式	DCスパッタ/平行平板型
高圧電源	0.8, 1.4kV / 0~50mA
到達圧力	8Pa
チャンバーサイズ	240 (dia.) × 240 (depth) mm (ステンレス製)
タイマー	0~15min 連続
ガス導入機構	ニードルバルブ
排気装置	直結型ロータリーポンプ 100L/min (自動リーク付)
設置電源	単相 AC100V 50/60Hz 10A
寸法・重量	本体: 282 (W) × 450 (D) × 440 (H) mm, 20kg R P : 460 (W) × 175 (D) × 265 (H) mm, 22kg

※本仕様は、性能改善のため予告なしに変更されることがあります。

Standard target	4~8 inch dia.
Sample base	4~8 inch dia.
Evacuation operation	Automatic
Sputtering system	DC Sputtering / Parallel-plate type
High voltage power supply	0.8, 1.4kV / 0~20mA
Degree of vacuum	8Pa
Chamber size	240 (dia.) × 240 (depth) mm (made of stainless steel)
Timer	0~15min continuous
Gas regulating mechanism	Needle valve
Rotary pump	Directly-connected rotary pump 100L/min (with automatic leaking system)
Power supply	Single phase AC100V 50/60Hz 10A
Dimensions and weight	Main unit : 282 (W) × 450 (D) × 440 (H) mm, 20kg R P : 460 (W) × 450 (D) × 440 (H) mm, 22kg

※These specifications may be changed without prior notice for the sake of improvement.

## 営業品目 / Lines of Business

### ■真空応用機器

- スパッタ装置  
Desk Top Quick Coater (2~8インチ用)  
RF/DCスパッタ装置
- 真空蒸着装置  
抵抗加熱タイプ  
EBタイプ
- 真空排気装置

### ■電子顕微鏡関連機器

- 電子線描画用パターン発生装置
- SEM用特殊ステージ  
試料加熱/引張試験ステージ  
描画用モーターステージ etc.
- SEM/TEM用マニピュレータ
- 3次元計測装置
- 立体画像観察装置 3D-SEM®
- 高精細画像取込装置

### ■その他、各種関連機器の試作・開発・製造・販売

### ■Vacuum applied equipment

- Sputter coater  
Desk Top Quick Coater (2~8inch)  
RF/DC Sputtering equipment
- Vacuum evaporation equipment  
Thermal resistance type  
Electron beam type
- Vacuum pumping down equipment

### ■Electron microscopic equipment

- Pattern generator for EB lithography
- Special stage for SEM  
Heating & tensile testing stage  
Motor stage for EB lithography etc.
- Manipulator for SEM/TEM
- 3 dimensional measurement device
- Stereo image observation device 3D-SEM®
- High resolution image capturing system

### ■Prototyping, development, manufacturing and sales of a variety of related equipment

**R100**

このカタログは古紙配合率100%  
再生紙を使用しています。

**PRINTED WITH  
SOY INK™**

このカタログは大豆油インキで  
印刷しています。

サンヨー電子株式会社

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-6  
TEL.03-3363-3551 FAX.03-3364-2892  
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>

SANYU ELECTRON CO., LTD.

1-22-6, HYAKUNIN-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO, 169-0073, JAPAN  
TEL.81-3-3363-3551 FAX.81-3-3364-2892  
URL : <http://www.sanyu-electron.co.jp>